

奈米中心 圖形產生系統實作考核記錄表

修訂日期：110 年 1 月 27 日

姓名：_____ 學校系所：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、機況檢查

- 1.操作前檢查(廠務、機台)
- 2.逃生路線

二、操作注意事項

- 1.試片限制(尺寸、厚度、材料正負表列)
- 2.禁止事項

三、操作程序與方法

試片之載入與載出

- 1.標準(校正)試片之種類、固定位置、用途
- 2.試片 Holder 之取放方法、試片之固定
- 3.試片 Holder 如何放入 load lock 中
- 4.試片 Holder 之 Load、Unload

電子束校正

- 1.Column Mode
- 2.Write Field 選擇
- 3.Focus、Stigmator、Position
- 4.試片之 Focus、WF Alignment

圖形檔案處理

- 1.圖檔開啟、編輯(dose、array)
- 2.工作區域設定

圖形曝寫

- 1.試片座標設定
- 2.曝光參數設定
- 3.圖層、工作區域選擇
- 4.Position list 設定

Overlay

- 1.Alignment Mark 之設計
- 2.Alignment 之設定

考核時間：__ : __ ~ __ : __ 考核員簽名：_____ 總分：_____

備註：80 分及格